

半導体関連機器・学外利用料金表

2024年5月1日

番号	機器名	メーカー・型式	機器情報	利用料金	
半導体プロセス、洗浄					
A001	UV・オゾンクリーナー(CMOS用)	サムコ・Model UV-300	詳細	90,000円/日(何台使っても)	
A002	UV・オゾンクリーナー(センサ/MEMS用)	サムコ・Model UV-1	詳細		
A003	バッチ式Siウエハ洗浄装置	CWC・4+4M	詳細		
A004	超臨界洗浄・乾燥装置	レクザム・SCRD4	詳細		
半導体プロセス、成膜					
A005	CMOS用Alスパッタ装置	アネルバ・直流スパッタシステム	詳細		
A006	マルチターゲットRF/DCスパッタ装置 (CMOS用)	キャノンアネルバ・E-400S	詳細		
A007	酸化膜用スパッタ装置	キャノンアネルバ・E-200S	詳細		
A008	イオンコータ	アルバック機工・VPS-050	詳細		
A010	プラズマCVD装置 (CMOS用)	サムコ・PD-220M	詳細		
A011	プラズマCVD装置 (MEMSデバイス用)	サムコ・PD-220NS	詳細		
A012	リフロー用プラズマCVD装置 (CMOS用)	サムコ・PD-220NLM	詳細		
A013	LPCVD装置 (CMOS用)	ディー・エス・アイ・DJ-11S689-M3	詳細		
A014	LPCVD装置 (MEMS用)	ディー・エス・アイ・DJ-11S689-M3	詳細		
A015	パリレンコータ	日本パリレン・PDS2010	詳細		
A016	高真空蒸着装置	サンバック・Ed-1600			
A017	機能性絶縁膜堆積装置(PECVD装置)	住友精密工業・Cetus			
半導体プロセス、酸化・熱処理					
A018	CMOS用 酸化・アニール炉	光洋リンドバーグ・MODEL272H-300H15X070H	詳細		
A019	水素アニール炉 (CMOS用)	光洋サーモシステム・KTF773N-AS	詳細		
A020	水素アニール炉 (Si汎用)	光洋リンドバーグ・272M-200H15X070H	詳細		
A021	2段酸化炉 (Al2O3/Si基板用、Si汎用)	光洋サーモシステム	詳細		
A023	リン拡散炉	光洋リンドバーグ・272M-200H15X070H	詳細		
半導体プロセス、イオン注入					
A024	イオン注入装置	日新イオン機器・EXCEED2300SDV	詳細		
半導体プロセス、リソグラフィ					
A025	i線ステッパ	ニコンテック・NSR-TFHi12CH	詳細		
A026	コンタクトマスクアライナ (2インチ自動ローディング)	キャノン販売・PLA-501(F)	詳細		
A027	コンタクトマスクアライナ (2インチ自動ローディング)	キャノン・PLA-501(F)	詳細		
A028	コンタクトマスクアライナ (2インチ手動ローディング)	キャノン・PLA-501	詳細		
A029	コンタクトマスクアライナ (4インチ手動ローディング)	キャノン・PLA-600	詳細		
A030	両面アライナ	SUSS・Micro Tec AG	詳細		
A031	EB描画装置	日本電子・JBX-6300DA	詳細		
A032	i線用レジスト塗布・現像装置	ASAP・PRD4-000-07-2	詳細		
A034	レジストアッシング装置 (CMOS用)	サムコ・PC-1100	詳細		
A035	レジストアッシング装置 (MEMS用)	サムコ・Model PX-250M	詳細		
A036	微細パターン高速形成装置(マスクレス描画装置)	大日本科研・MX-1205			

番号	機器名	メーカー・型式	機器 情報	利用料金
半導体プロセス、加工・エッチング				90,000円/ 日(何台使っ ても)
A037	集束イオンビーム加工装置（FIB）	エスアイアイ・ナノテクノロジー・SMI3200TS	詳細	
A038	反応性イオンエッチング装置（MEMS F系ガス用）	サムコ・RIE-200F	詳細	
A039	反応性イオンエッチング装置（MEMS Cl系ガス用）	サムコ・RIE-200NL	詳細	
A040	反応性イオンエッチング装置（CMOS F系ガス用）	アネルバ・L-451D-L	詳細	
A041	反応性イオンエッチング装置（CMOS Cl系ガス用）	アネルバ・L-451D-L	詳細	
A042	Si深堀りエッチング装置（Deep-RIE）	住友精密工業・MUC21-RD	詳細	
A043	誘導結合型反応性イオンエッチング装置（ICP-RIE）	アルバック・CE-300I	詳細	
A044	Siエッチング装置（XeF2ガス）	Xactix・Xetech E1-β	詳細	
A045	集積化センサ加工装置(ICPRIE装置)	住友精密工業・Sirius		
半導体プロセス、後工程				
A046	Siウエハ用レーザーダイシング装置	東京精密・ML200	詳細	
A047	ダイシングソー	東京精密・A-WD-10A	詳細	
A048	ワイヤーボンダー（Au）	ハイソル・West bond 7700D-79	詳細	
A049	ワイヤーボンダー（Al）	ハイソル・West bond 7476D	詳細	
半導体プロセス、観察・評価				
A050	CLSM：レーザー顕微鏡	オリンパス・OLS3100	詳細	
A051	SEM：測長機能付き走査型電子顕微鏡	日本電子・JSM-7100F	詳細	
A052	温度可変プローバ・計測器システム	ハイソル	詳細	
A053	ウエハプローバ・計測器システム	東京精密・A-PM-50A、 アジレント・4155C	詳細	
A054	光干渉膜厚計	大日本スクリーン製造・VM-1230		
加工・エッチング				
A055	FIB：集束イオンビーム装置	日立ハイテクノロジーズ・NB5000	詳細	
観察・評価				
A056	CLSM：正立型共焦点顕微鏡	ニコン・A1rsi-TY	詳細	
A057	SEM：EDS付走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ・S-3000N： Thermo Fisher・NORAN SYSTEM SIX	詳細	
A058	デジタルマイクロスコープ	キーエンス・VHX-500	詳細	
分光分析				
A059	高速イメージング顕微ラマン分光システム	日本分光・NRS-7100	詳細	
A060	PL(フォトルミネッセンス)/RAMAN 測定装置	HORIBA Jobin Yvon・LabRAM HR-800	詳細	

分析計測機器・学外利用料金表

2024年5月1日

番号	機器名	メーカー・型式	機器 情報	単位時間 (h)	利用料金 (円)	
顕微鏡						
B001	TEM：透過型電子顕微鏡	日本電子・JEM-2100F	詳細	5 1	お問い合わせください	
B002	透過型電子顕微鏡（Transmission Electron Microscope）	日本電子・JEM-1400Plus	詳細	5 1		
B003	電界放出形走査電子顕微鏡（Field Emission Scanning Electron Microscope）	日立ハイテクノロジーズ・SU8000 Type II	詳細	1		
B004	走査型電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope）	日本電子・JSM-IT100	詳細	1		
B005	低真空走査電子顕微鏡（Low-vacuum Scanning Electron Microscope）	日立ハイテクノロジーズ・SU3500	詳細	1		
B006	光学顕微鏡（Optical Microscope）	ZEISS・Axiophoto	詳細	1		
B007	デジタルマイクロスコープ (Digital Microscope)	キーエンス・VHX-8000	詳細	1		
B008	白色干渉計搭載 レーザ顕微鏡 (3D Laser Scanning Microscope)	キーエンス・VK-X3000/3100	詳細	1		
顕微鏡試料作製						
B009	薄膜断面試料作製装置（Ion Slicer）	日本電子 EM-09100IS	詳細	1		
B010	精密イオン研磨システム（Precision Ion Polishing System）	日本電子 Model691	詳細	1		
B011	常温・凍結切片作製用ウルトラミクロトーム（Cryo-Ultramicrotomes）	ライカ・EM UC7	詳細	1		
分光分析						
B012	顕微FT-IRスペクトル装置（Microscopic FT-IR Spectrophotometer）	日本分光 FT/IR6600	詳細	1		
B013	紫外可視分光光度計（Spectrometer for Ultraviolet and Visible Region）	日本分光 V-550	詳細	1		
B014	紫外可視近赤外分光光度計（UV-Visible-NIR Spectrophotometer）	島津製作所 UV-3600Plus	詳細	1		
B015	分光蛍光光度計（Fluorescence Spectrophotometer）	日立・F-7000	詳細	1		
B016	グロー放電発光分析装置（Glow Discharge Optical Emission Spectrometry）	堀場製作所・GD-Profler2	詳細	1		
B017	誘導結合プラズマ発光分析装置（Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer）	サーモフィッシャーサイエンティフィック・iCAP-7200 Duo	詳細	1		
X線分析						
B018	強力X線回折装置（X-ray Diffractometer with Rotating Anode X-ray Generator）	理学 RINT-2500	詳細	1		
B019	四軸型単結晶X線回折装置（単結晶X線構造解析装置）（4-axis Single Crystal X-ray Diffractometer System）	理学 RASA-7R/AFC-7R	詳細	12 1		
B020	X線光電子分光装置（X-ray Photoelectron Spectroscopy/Electron Spectroscopy for Chemical Analysis）	アルバックファイ PHI Quantera SXM-CI	詳細	1		

番号	機器名	メーカー・型式	機器 情報	単位時間 (h)	利用料金 (円)
B021	エネルギー分散形蛍光X線分析装置（Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer）	日本電子 JSX-3100R II	詳細	1	お問い合わせ ください
B022	マイクロフォーカスX線CT装置（Micro focus X-ray CT Scanner）	島津製作所・inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus	詳細	1	
B023	X線回折装置（X-ray Diffractometer）	リガク・SmartLab	詳細	1	
核磁気共鳴					
B025	NMR：核磁気共鳴装置	日本電子・JNM-ECX500	詳細	-	
B026	NMR：核磁気共鳴装置	日本電子・JNM-ECS400	詳細	-	
汎用分析・計測					
B027	粒度分布測定装置（Particle Size Distribution Analyzer）	島津製作所・SALD-2300	詳細	1	

工作機器・学外利用料金表

2024年5月1日

番号	機器名	メーカー・型式	機器 情報	単位時間 (h)	利用料金 (円)
切削加工					
C001	普通旋盤 (Manual Lathe)	滝澤鉄工所・TAL-510-1000	詳細	1	お問い合わせ ください
C002	普通旋盤 (Manual Lathe)	滝澤鉄工所・TAL-510-1500	詳細	1	
C003	普通旋盤 (Manual Lathe)	滝澤鉄工所・TAL-510-1500	詳細	1	
C004	一般旋盤 (Manual Lathe)	滝澤鉄工所・TSL-550	詳細	1	
C005	C N C 普通旋盤 (CNC/Manual Lathe)	滝澤鉄工所・TAC-510L15	詳細	1	
C006	C N C 普通旋盤 (CNC/Manual Lathe)	滝澤鉄工所・TAC-510L10	詳細	1	
C007	C N C 普通旋盤 (CNC/Manual Lathe)	米国HAAS・TL-1	詳細	1	
C008	CNC旋盤 (8inチャック仕様) (1-Saddle CNC Lathe)	オークマ・SPACE TURN LB3000EX II MY + OSP P300L	詳細	1	
C009	フライス盤 (Milling Machine)	エンシュウ・SEV + SCALE CONTROL Ⅲ	詳細	1	
C010	フライス盤 (Milling Machine)	エンシュウ・HF2 + XY Digital Scale	詳細	1	
C011	フライス盤 (Milling Machine)	大隈豊和・FMV-30	詳細	1	
C012	フライス盤 (Milling Machine)	大鳥機工・ON-3VⅡ + FANUC 20i-FB	詳細	1	
C013	横形マシニングセンタ (Horizontal Machining Center)	オークマ・MA-40HA+OSP U100M	詳細	1	
C014	立形マシニングセンタ (Vertical Machining Center)	オークマ・MP-46V・標準仕様 <高面品 位仕上用>	詳細	1	
C015	立形マシニングセンタ (Vertical Machining Center)	オークマ・MP-46V 特別仕様 <広軸仕 様>	詳細	1	
C016	シェーパー	ナカガワ	詳細	1	
穿孔					
C017	ボール盤 (Drilling Machine)	帝人大隈・DMB	詳細	1	
C018	ボール盤 (Drilling Machine)	大鳥機工・BR-C1250	詳細	1	
C019	ボール盤 (Drilling Machine)	吉良鉄工所・TYPE KID-420	詳細	1	
C020	ボール盤 (Drilling Machine)	吉良鉄工所・KRDG-340	詳細	1	
C021	ボール盤 (Drilling Machine)	アシナ・TYPE ASD-360	詳細	1	
切断					
C023	CNCワイヤ放電コンタマシン (CNC MOLYBDENUM WIRE CUT EDM)	タイナテック・DKV7740	詳細	1	
C024	レーザーカッター (CO2+Fiber Laser Cutter)	TROTEC・SPEEDY300 FLEXX	詳細	1	
C025	プラズマ切断機 (Plasma Cutting Machine)	ダイヘン・D-12000G	詳細	1	
C026	ファインカット (High-speed Precision Cutting Machine)	平和テクニカ・HS-100	詳細	1	
C027	ファインカット (High-speed Precision Cutting Machine)	平和テクニカ・HS-45AⅡ	詳細	1	
C028	高速切断機 (Friction Sawing Machine)	昭和機械工業・SK-4R 5.5KW 全閉型仕 様	詳細	1	
C029	高速切断機 (Friction Sawing Machine)	昭和機械工業・SK-300M	詳細	1	
C030	シャーリングマシン (Shearing Machine)	アマダ・S-2532	詳細	1	
C031	シャーリングマシン (Shearing Machine)	相澤鉄工所・AAA C512	詳細	1	
C032	シャーリングマシン (Shearing Machine)	ヤマシナエンジニアリング・OSE-1320	詳細	1	
C033	コンターマシン (Contour machine (Band Saw))	LUXO・LE-500	詳細	1	
C034	コンターマシン (Contour machine (Band Saw))	アンドソー・TA500	詳細	1	
C035	ノコ盤 (Metal Cutting Machine (Band Saw))	アマダ・H550E	詳細	1	
C036	プレスブレーキ (Bending Machine)	アマダ・RG25	詳細	1	

番号	機器名	メーカー・型式	機器 情報	単位時間 (h)	利用料金 (円)	
C037	炭酸ガスレーザ加工機（CO2 Laser Processing Machine）	三菱電機・ML806T3+3016C	詳細	1	お問い合わせください	
C038	炭酸ガスレーザ加工機（CO2 Laser Processing Machine） 酸素使用、アルミ・銅・黄銅切断時	三菱電機・ML806T3+3016C	詳細	1		
C039	ウォータージェットカッター（Water-Jet Cutter）	コムネット・WAZER	詳細	1		
C040	可搬式プラズマ切断機（Portable Plasma Cutting Machine）	ダイヘン・M-1500C（エアープラズマ）	詳細	1		
研削						
C041	平面研削盤（Surface Grinding Machine）	長瀬鉄工所・SGM-52	詳細	1		
C042	円筒研削装置付万能工具研削盤（Universal Tool Grinding Machine）	TOP WORK・M-40	詳細	1		
C043	集塵機付レジンベルト（Belt Sander（Belter））	松下電工・BY-47L	詳細	1		
研磨						
C047	エアラップ（Lapping Machine）	東洋研磨材工業・鏡面ショットSMAP-Ⅲ型	詳細	1		
塑性加工						
C048	6型2段DR圧延機（Rolling Machine）	大野ロール・2RM-160DR	詳細	1		
C049	卓上型冷間溝圧延機（Desktop Cold Groove Rolling Mill）	大野ロール・2RM-63J	詳細	1		
C050	スウェーピングマシン（Swaging Machine）	大野ロール・RSM-4S2	詳細	1		
溶接						
C051	被覆アーク溶接機（Shielded Metal Arc Welding）	ダイヘン・BS250M	詳細	1		
C052	被覆アーク溶接機（Shielded Metal Arc Welding）	ダイヘン BS250L 3台	詳細	1		
C053	アセチレンガスを用いる溶接・溶断器（Acetylene Gas Cutter/Welder）	ヤマト産業、小池酸素	詳細	1		
C054	TIG溶接機（Tungsten Inert Gas Welding）	ダイヘン・交直両用TIG DA-300P	詳細	1		
C055	TIG溶接機（Tungsten Inert Gas Welding）	National・交直両用TIG YE-200BR1	詳細	1		
C056	MIG溶接機（Metal Inert Gas Welding）	日立・インターパルスミグ350A DT-CAP2	詳細	1		
C057	MAG溶接機（Metal Active Gas Welding）	ダイヘン・NEW500SG	詳細	1		
C058	CMT溶接機（Cold Metal Transfer Welding Process Machine）	フローニクス・TPS2700	詳細	1		
C059	セルフシールドアーク溶接機	LINCOLN・SP-100T	詳細	1		
C060	定置式交流ポット溶接機（Stationary Resistance Spot Welding）	ダイヘン・SLAJS35-601	詳細	1		
C061	直流移動式スポット溶接機（Mobile Spot Welding Machine）	デンゲン・SW-7600/DX	詳細	1		
C062	スタッド溶接機（Stud Welding Machine）	日本ドライビット・CD-800型	詳細	1		
C063	放電肉盛装置（Electro-Spark Deposition）	テクノコート・スパークデポ MODEL 300	詳細	1		
放電加工						
C064	高速細穴放電加工機（Small Hole EDM Drilling）	イースタン技研・ESM-8VT複合機	詳細	1		
C065	ワイヤ放電加工機（Wire Electric Discharge Machine）	三菱電機・SX20	詳細	1		

番号	機器名	メーカー・型式	機器 情報	単位時間 (h)	利用料金 (円)
C066	ワイヤ放電加工機（Wire Electric Discharge Machine）	三菱電機・SX20	詳細	1	お問い合わせ ください
3Dプリンタ					
C067	3Dプリンタ（3D Printer）	3DSYSTEMS・ProJet3510HD Plus 2台	詳細	1	
C068	3Dプリンタ（樹脂用）（3D Printer）	KEYENCE・AGILISTA-3200	詳細	1	
C069	3Dプリンタ（カーボンファイバ混合用）（3D Printer）	Markforged・MarkTwo	詳細	1	
汎用分析・計測					
C070	ハンディプローブ三次元測定機（Handheld Probe Coordinate Measuring Machine）	KEYENCE・XM-1200		1	
C071	3Dスキャナ型三次元測定機（3D Scanning Measurement System）	KEYENCE・VL-570	詳細	1	

可搬型機器・学外利用料金表

2024年5月1日

番号	機器名	メーカー・型式	機器 情報	貸出期間	利用料金 (税別)
D001	高速度カメラ (High Speed Camera)	フotron・FASTCAM MiniAX200	詳細	2週間以内	20,000円
D002	赤外線カメラ (低温～中温) (Infrared Camera)	OPTRIS/アルゴ・PI640i OF033	詳細	2週間以内	6,000円
D003	赤外線カメラ (中温～高温) (Infrared Camera)	OPTRIS/アルゴ・PI 1 M OF25	詳細	2週間以内	4,000円
D004	赤外線カメラ (高温) (Infrared Camera)	OPTRIS/アルゴ・PI05 OF25	詳細	2週間以内	5,000円
D005	ミラーレスカメラ (Mirrorless Camera)	Nikon・Z6 II 24-70 レンズキット	詳細	2週間以内	4,000円
D006	電力モニタ (パワーメータ) (Power Meter)	HIOKI・PW3335	詳細	2週間以内	1,000円
D007	電力モニタ (クランプオンパワーロガー) (Clamp on Power Logger)	HIOKI・PW3365-10	詳細	2週間以内	1,000円
D008	データロガー (高速度カメラ連携可) (Data Logger)	グラフテック・midiLOGGER GL980	詳細	2週間以内	2,000円
D009	電力モニタ (ワイヤレスクランプロガー) (Wireless Clamp Logger)	HIOKI・LR8513	詳細	2週間以内	400円
D010	パーティクルカウンター (Particle Counter)	日本カノマックス・Model3889-01	詳細	2週間以内	4,000円
D011	紫外線測定器 (UV-A, B, C各プローブ付き) (Illuminance/luminance/irradiance meter)	Delta OHM・HD2102.1-HD2102.2	詳細	2週間以内	1,000円
D012	EMCプローブ_LF1(Near Field Probes 100 kHz up to 50 MHz)	Langer・Near-Field Probes set LF1 set	詳細	2週間以内	0円
D013	EMCプローブ_RF6(Near Field Probes 30 MHz up to 3 GHz)	Langer・Near-Field Probes set RF6 set	詳細	2週間以内	0円
D014	リアルタイム・スペクトラム・アナライザ	日本テクトロニクス RSA3303A-02,R3		2週間以内	0円
D015	インピーダンスアナライザ	日置電機(株) IM3536 LCRメーター		2週間以内	0円
D016	USB熱電対パワーセンサー#1	キーサイト・テクノロジー U8481A 他		2週間以内	0円
D017	USB熱電対パワーセンサー#2	キーサイト・テクノロジー U8481A 他		2週間以内	0円
D018	オシロスコープ	テクトロニクス TPS2014B		2週間以内	0円
D019	差動プローブ#1	Testec 15106 70MHz 7000V		2週間以内	0円
D020	差動プローブ#2	Testec 15106 70MHz 7000V		2週間以内	0円
D021	ワイヤレスロギングステーション	日置電機(株) LR8410-91		2週間以内	0円
D022	デジタルマルチメーター3458A	AgilentTechnologies		2週間以内	0円